



證書

學員 000 (身分證字號 000000000000)，於民國 000 年 00 月 00 日起至民國 000 年 00 月 00 日止參加國立高雄大學辦理之「半導體微影製程」課程 (職能級別第 2 級)，訓練總時數 48 小時、學習成果評量 6 小時共計 54 小時，學習期滿經考核通過後結訓。

特此證明

主辦單位： 國立高雄大學

負責人姓名：陳月端



職能導向課程

MPDT0027-21

標章效期：110.06.04-113.06.04

本課程通過勞動部勞動力發展署職能導向課程品質認證，標章編號 MPDT0027-21

認證課程查詢請至：<https://icap.wda.gov.tw/>

中華民國 000 年 00 月 00 日



本課程通過勞動部勞動力發展署職能導向課程品質認證，標章編號 MPDT0027-21

認證課程查詢請至：<https://icap.wda.gov.tw/>

課程能力 養成描述	工作任務 T1 協助微影機台相關的製程工作。 工作任務 T2 協助維持生產製程流程的順暢。 工作任務 T3 協助完善生產製程流程提升良率。 工作任務 T4 協助溝通產線需要的製程條件，協助制定與確立製程參數。 工作任務 T5 協助調整製程條件。協助現有生產製程與新物料的試用，量產使用評估。 工作任務 T6 協助解決生產製程問題，分析異常問題。 工作任務 T7 協助修改與維護流程卡、run card。 工作任務 T8 協助單站製程缺陷改善與工具使用分析。 工作任務 T9 協助現有生產機台評估與擴充機台規劃。		
	課程單元名稱	職能級別	單元時數
半導體產業介紹	2	7	
光阻與光化學	2	7	
微影成像原理	2	8	
曝光設備技術	2	6	
期中學習測驗	2	3	
EUV 微影技術	2	3	
光罩技術	2	2	
Resolution enhancement techniques	2	2	
Track 設備與製程	2	3	
量測技術與 SEM 實作	2	5	
統計分析與生產控制	2	5	
期末學習測驗	2	3	
本課程係依據經濟部建置之「半導體產業製造類-製程工程師職能基準」之部分共通職能規劃辦理，基準代碼為 MPD3135-001v3。			

註：職能級別共分為 1-6 級，第 6 級為最高級別

職能級別查詢請至：https://icap.wda.gov.tw/Knowledge/knowledge_introduction.aspx